

บทความวิชาการ

ทราบชีสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวและการประยุกต์

สุธีร์ สัมพันธ์อภัย* และ ศุภชัย ฤทธิ์เจริญวัฒ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับนาโนเมตร ทำให้พัฒนาระบบของอุปกรณ์แตกต่างจากอุปกรณ์แบบดั้งเดิม ในอุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบที่เรียกว่า “เกาะ” จะเชื่อมโยงกับภายนอกผ่านรอยต่อการหล่อผ่าน ลักษณะดังกล่าวทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของระดับพลังงานอิเล็กตรอนภายในเกาะ ซึ่งนำไปสู่ปรากฏการณ์การขัดขวางแบบคูลอมบ์ ปรากฏการณ์นี้สามารถใช้ควบคุมอิเล็กตรอนเดี่ยวในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล่องอิเล็กตรอนเดี่ยว และทราบชีสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยว

เพื่อให้เกิดปรากฏการณ์การขัดขวางแบบคูลอมบ์ โครงสร้างต้องประกอบด้วย รอยต่อการหล่อผ่าน รอยต่อตัวเก็บประจุ เกาะและข้าไฟฟ้าที่เชื่อมโยงจากภายนอก โดยข้าไฟฟ้าทำหน้าที่ควบคุมระดับพลังงานของอิเล็กตรอนภายในเกาะ อิเล็กตรอนเดี่ยวจะหล่อผ่านรอยต่อการหล่อผ่านเข้า / ออกจากเกาะ ตามแรงดันไฟฟ้าที่ข้าไฟฟ้า แม้กล่องอิเล็กตรอนเดี่ยวเป็นอุปกรณ์ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สุด แต่โครงสร้างนี้ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ ในขณะที่โครงสร้างอย่างง่ายของทราบชีสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวมีช่องทางให้อิเล็กตรอนผ่านได้ ทำให้โครงสร้างนี้สามารถใช้งานได้จริง ดังนั้น บทความนี้จะเน้นกลไกการทำงานและการประยุกต์ที่สำคัญของทราบชีสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยว โดยอุปกรณ์ชนิดนี้ใช้พลังงานต่ำและมีความไวสูง ต่อสถานภาพไฟฟ้า ฉะนั้น ทราบชีสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวจึงสามารถประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ได้ เช่น ชูปเปอร์เซนซิฟอิเล็กทรอมิเตอร์ และเกตตอร์รากะอิเล็กตรอนเดี่ยว อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์นี้ยังต้องได้รับการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้

คำสำคัญ: กล่องอิเล็กตรอนเดี่ยว ทราบชีสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยว ปรากฏการณ์การขัดขวางแบบคูลอมบ์ มิเตอร์สถานภาพไฟฟ้าความไวสูง เกตตอร์รากะอิเล็กตรอนเดี่ยว

Single-Electron Transistors and Applications

Sutee Sampan-a-pai* and Supachai Ritjareonwattu

ABSTRACT

The state-of-the-art technology can be used to fabricate nanoscale electronic devices. The nanoscale electronic device does not show the same behavior as a traditional electronic device, but exhibits the quantum phenomena. In the nanostructure, an isolated part, so-called “island”, is connected to an external electrode via a tunneling junction. With this nanostructure and connection, the discreteness of electron states leads to the coulomb blockade phenomenon. This quantum phenomenon can be used to control a single electron in various single-electron devices, such as single-electron boxes and single-electron transistors.

To produce the coulomb blockade effect, the structure of single-electron devices must be consisted of tunneling junctions, capacitive junctions, islands and electrodes which are connected to external leads. The voltage is applied to the gate electrode to control the increase or decrease of a single electron in the island. A single-electron box has the simplest structure among these devices. However, the structure of single-electron boxes is impractical for utilization. In contrary to the box, the simple structure of single-electron transistors does not trap the electron inside their island. With its passable structure, the transistor can be used in practice. This article therefore focuses on the mechanism of single-electron transistors, as well as their main applications. The single-electron transistor not only consumes low energy, but also has high sensitivity to the electric field. They are thus used in various applications, such as supersensitive electrometers and single-electron logic gates. However, some further research and development are needed to commercialize these single-electron devices.

Keywords: Single-electron box, Single-electron transistor, Coulomb blockade, Supersensitive electrometer, Single-electron logic gate

Theoretical Condensed Matter Physics Research Unit, Department of Physics, Faculty of Science, Mahasarakham University

*Corresponding author, email: sampanapai.s@gmail.com

บทนำ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากอดีตถึงปัจจุบัน มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ จึงได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในการวิจัยเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพลดลงความสามารถของอุปกรณ์ต่างๆ ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งการพัฒนาในอดีตที่ผ่านมาจะเน้นการ ลดขนาดทางกายภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไร ก็ตาม ปัจจุบันแนวทางดังกล่าวถึงขีดจำกัดในการพัฒนา เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันมีขนาด ทางกายภาพในระดับนาโนเมตร ดังนั้น การลดขนาดจะส่งผลให้คุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปและแสดงพฤติกรรมทางไฟฟ้าที่เป็นผลจากปรากฏการณ์ทางคุณต้ม ในอดีต การประยุกต์ใช้ปรากฏการณ์ทางคุณต้มในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประสบปัญหาและอุปสรรคหลาย ประการ เช่น ความแม่นยำในการสร้างอุปกรณ์ที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร และความก้าวหน้าทางด้านวัสดุ- ศาสตร์ที่มีจำกัด แต่ในปัจจุบันปัญหาเหล่านี้ได้รับการพัฒนาและแก้ไข จึงทำให้เทคโนโลยีในปัจจุบันมี ศักยภาพและความพร้อมในการประยุกต์ใช้ปรากฏการณ์ทางคุณต้มต่างๆ ในงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

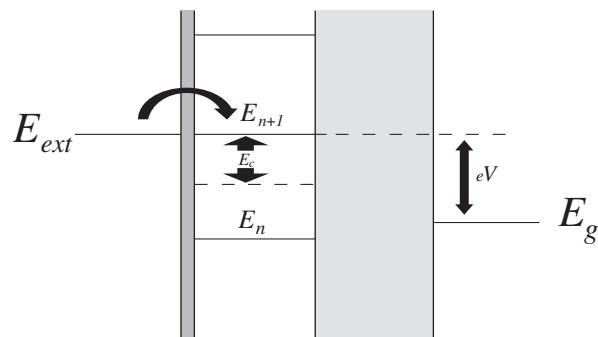
ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 มิลลิแกน (Millikan) ได้ค้นพบลักษณะความไม่ต่อเนื่องของประจุ โดย การคั่นபບดังกล่าว นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาและวิจัยทางด้านการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ ความรู้และเทคนิคต่างๆ ทางด้านฟิสิกส์ยังไม่ประสบผลสำเร็จในการควบคุมอิเล็กตรอนที่ละ 1 ตัว เนื่องจาก โดยมากความรู้และเทคนิคเหล่านั้นจะเป็นการพิจารณาผลของการประยุกต์ใช้ปรากฏการณ์ทางคุณต้ม แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันหลักการทำงานคุณต้มได้ถูกนำมาใช้ศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ในอุปกรณ์ที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร ซึ่งจากความสำเร็จในการอธิบายและทำนายพฤติกรรมต่างๆ ของอิเล็กตรอนในอุปกรณ์ขนาดเล็ก ทำให้เกิด แนวคิดในการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถควบคุมอิเล็กตรอนได้ทีละ 1 ตัว โดยเรียกอุปกรณ์ เหล่านี้ว่า อุปกรณ์อิเล็กตรอนเดี่ยว (Single-electron devices) [1] ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กตรอนเดี่ยวที่สามารถ นำมาประยุกต์ใช้งานได้ในปัจจุบัน ได้แก่ ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยว (Single-electron transistors) [1, 2] เนื่องจากทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน สามารถสร้างได้ง่าย แต่ในขณะเดียวกันอุปกรณ์ชนิดนี้มีคุณสมบัติโดยเด่นที่แตกต่างจากทรานซิสเตอร์แบบดั้งเดิม (Traditional transistor) ทำให้ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น เชนเชอร์ความไวสูง (Supersensitive sensors) [3-5] สิ่งประดิษฐ์เชิงตรรกะ (Logic devices) [6, 7] และคุณต้มคอมพิวเตอร์ (Quantum computers) [8]

บทความนี้เน้นอธิบายหลักการทำงานและการประยุกต์ใช้ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวชนิดโลหะ (Metallic single-electron transistors) โดยเริ่มจากพื้นฐานในการควบคุมอิเล็กตรอนทีละ 1 ตัว รวมถึง ปรากฏการณ์ทางกายภาพที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์อิเล็กตรอนเดี่ยว จากนั้น จะกล่าวถึงกล่องอิเล็กตรอนเดี่ยว (Single-electron boxes) ที่มีโครงสร้างอย่างง่ายที่สุด ตลอดจนแนวคิดในการประยุกต์กล่องอิเล็กตรอน เดี่ยวมาเป็นทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยว ตอนท้ายจะกล่าวถึงการประยุกต์ใช้ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอน เดี่ยวที่สำคัญใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การประยุกต์ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวในการสร้างมิเตอร์สานมาไฟฟ้าความไวสูง (Supersensitive electrometers) และการประยุกต์ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวในการ สร้างเกตตรรากะอิเล็กตรอนเดี่ยว (Single-electron logic gates)

กล่องอิเล็กตรอนเดี่ยว

ในปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กตรอนเดี่ยวมีหลายชนิดทั้งชนิดโลหะและสารกึ่งตัวนำ [1, 9] แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์อิเล็กตรอนเดี่ยว จำเป็นต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานของลิ่งประดิษฐ์ที่มีโครงสร้างอย่างง่าย ได้แก่ กล่องอิเล็กตรอนเดี่ยว โดยอุปกรณ์นี้สามารถแสดงปรากฏการณ์ที่สำคัญในอุปกรณ์อิเล็กตรอนเดี่ยว เรียกว่า ปรากฏการณ์การขัดขวางแบบคูลอมบ์ (Coulomb blockade effect) [10] ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กตรอนเดี่ยวสามารถควบคุมอิเล็กตรอนได้ทีละ 1 ตัว กล่องอิเล็กตรอนเดี่ยวประกอบด้วยรอยต่อการทะลุผ่าน (Tunneling junction) 1 รอยต่อ [11] เป็นรอยต่อที่อิเล็กตรอนสามารถทะลุผ่านไปยังบริเวณที่กักเก็บอิเล็กตรอนได้ เรียกว่า เกาะ (Island) ถัดจากเกาะจะเป็นรอยต่อตัวเก็บประจุ (Capacitive junction) ซึ่งกันไม่ให้อิเล็กตรอนทะลุผ่านไปได้ นอกจากนี้ รอยต่อการทะลุผ่านจะค่อนอยู่ระหว่างชั้นไฟฟ้ากับเกาะ และรอยต่อตัวเก็บประจุจะค่อนอยู่ระหว่างเกาะกับชั้นไฟฟ้าที่เรียกว่า ชั้วเกต (Gate electrode) โดยชั้วเกตทำหน้าที่เหนี่ยวแน่นประจุอิเล็กตรอนจากชั้นไฟฟ้าผ่านตรงข้ามเข้ามายังเกาะ โครงสร้างลักษณะนี้จะมีทางเข้า/ออกของอิเล็กตรอนเพียง 1 ช่องทางผ่านรอยต่อการทะลุผ่านเท่านั้น จึงถูกเรียกว่า กล่องอิเล็กตรอนเดี่ยว

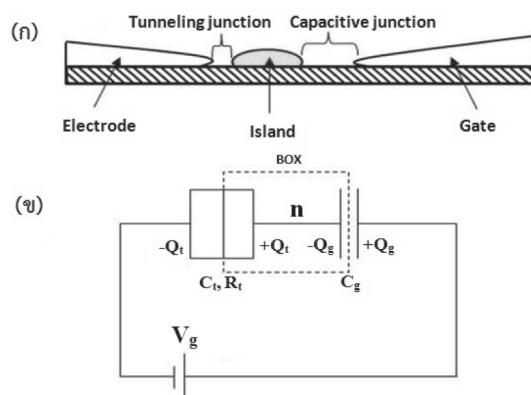
การควบคุมอิเล็กตรอนให้เข้ามายังในเกาะ สามารถทำได้โดยจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าที่ชั้วเกต ของกล่องอิเล็กตรอนเดี่ยว ซึ่งได้อธิบายดังรูปที่ 1 จากรูปเมื่อให้แรงดันไฟฟ้าที่ชั้วเกต อิเล็กตรอนจะถูกเหนี่ยวนำให้ทะลุผ่านรอยต่อการทะลุผ่านเข้าไปยังเกาะ กล่าวคือ จำนวนอิเล็กตรอนในเกาะจะเพิ่มขึ้นจาก n เป็น $n + 1$ และจำนวนอิเล็กตรอนจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น $n + 2$ เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ชั้วเกตมีค่าเพิ่มขึ้น



รูปที่ 1 แผนภาพการควบคุมอิเล็กตรอนของกล่องอิเล็กตรอนเดี่ยวขณะที่จ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ชั้วเกต เมื่อ E_g คือ ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนที่ชั้วเกต E_{ext} คือ ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนที่อยู่ภายนอกเกาะ และ E_n , E_{n+1} คือ ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนที่อยู่ภายในเกาะ

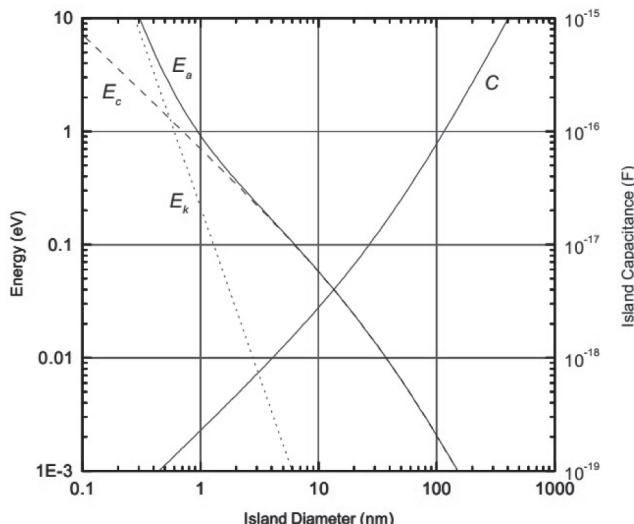
จากรูปที่ 1 การเพิ่มอิเล็กตรอนเข้าไปภายในกระแสต้องให้พลังงานค่าหนึ่งที่เรียกว่า พลังงานการเพิ่มประจุ (Charging energy, E_C) [2] โดยเป็นพลังงานที่มีค่าน้อยที่สุดในการเพิ่มอิเล็กตรอน 1 ตัวเข้าไปในกระแส โดยที่พลังงานการเพิ่มประจุสามารถคำนวณได้จากทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามสมการ $E_C = e^2/2C_\Sigma$ เมื่อ $C_\Sigma = C_t + C_g$ คือความจุรวมของกล่องอิเล็กตรอนเดี่ยว ในการเพิ่มอิเล็กตรอนเข้าไปในกระแสจะทำให้พลังงานรวมของระบบเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถคำนวณการเปลี่ยนแปลงพลังงานรวมได้จากสมการ $\Delta E = E_C(n - C_g V_g/e)^2$ เมื่อ $n = (Q_t - Q_g)/(-e)$ [1] คือ จำนวนอิเล็กตรอนส่วนเกิน (Excess electrons) ภายในกระแส การสร้างอุปกรณ์ให้มีลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าเหมือนกับแผนภาพในรูปที่ 1 จำเป็นต้องมีโครงสร้างตัวเก็บประจุสองโครงสร้างคือ รอยต่อขนาดเล็ก (รอยต่อการทะลุผ่าน, C_t) และรอยต่อขนาดใหญ่ (ตัวเก็บประจุ, C_g) มาต่ออนุกรมกันดังแสดงในรูปที่ 2 (ก) โดยภายในโครงสร้างของกล่องอิเล็กตรอนเดี่ยวลักษณะนี้ เกาะจะถูกแยกออกจากชั้นไฟฟ้าด้วยรอยต่อห้องสอง ซึ่งองค์ประกอบบนห้องน้ำจะถูกวางอยู่บนแผ่นอนุวนเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วของอิเล็กตรอนจากกระแสไปยังชั้นไฟฟ้า

จากลักษณะทางกายภาพ ทำให้โครงสร้างของรอยต่อ C_t และ C_g มีสมบัติเป็นตัวเก็บประจุ ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวของกล่องอิเล็กตรอนเดี่ยวในรูปที่ 2 (ก) สามารถเขียนวงจรสมมูลได้ดังรูปที่ 2 (ข) แต่อย่างไรก็ตาม รอยต่อการทะลุผ่าน C_t จะเป็นตัวเก็บประจุที่อิเล็กตรอนสามารถทะลุผ่านได้ ในขณะที่รอยต่อ C_g เป็นรอยต่อที่มีความกว้างเพียงพอที่จะกันไม่ให้อิเล็กตรอนสามารถทะลุผ่านได้ ดังนั้น เมื่อกระแสอุ่นกว่างอยู่ตรงกลางระหว่างรอยต่อ C_t และ C_g จึงทำให้สามารถเก็บอิเล็กตรอนไว้ภายในกระแสได้ ซึ่งอิเล็กตรอนจะสามารถทะลุผ่านเข้ามาที่เกะได้โดยผ่านรอยต่อ C_t แต่จะไม่สามารถออกจากการเกะได้ ในการเพิ่มหรือลดจำนวนอิเล็กตรอนภายในกระแส จะสามารถทำได้โดยการให้พลังงานศักย์ผ่านการเชื่อมโยง (Coupling) จากภายนอกกระแสด้วยสนามไฟฟ้าที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้า V_g ดังในรูปที่ 2 (ข) การเพิ่มหรือลดอิเล็กตรอนตัวแรกภายในกระแสทำได้โดยการเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้า V_g ด้วยขนาด $\Delta V_g = e/2C_g$ ในขณะที่การเพิ่มหรือลดอิเล็กตรอนตัวต่อไปต้องเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าด้วยขนาด $\Delta V_g = e/C_g$



รูปที่ 2 (ก) โครงสร้างของกล่องอิเล็กตรอนเดี่ยวประกอบด้วยรอยต่อการทะลุผ่าน รอยต่อตัวเก็บประจุ เกาะและชั้นไฟฟ้า (ข) วงจรสมมูลของกล่องอิเล็กตรอนเดี่ยว

โดยปกติ ปัจจัยหลักในการควบคุมอิเล็กตรอนภายในแกะของกล่องอิเล็กตรอนเดียว คือ สนามไฟฟ้าจากภายนอก ซึ่งจะควบคุมพลังงานศักย์ของอิเล็กตรอนภายในระบบ แต่อย่างไรก็ตาม ในบางสภาวะ พลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนจะมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ทำให้ในสภาวะดังกล่าว การพิจารณาพลังงานศักย์ของอิเล็กตรอนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของ อิเล็กตรอนในกล่องอิเล็กตรอนเดียวได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น จึงต้องพิจารณาพลังงานรวมของอิเล็กตรอน ซึ่งเป็นผลรวมของพลังงานจลน์ (E_k) และพลังงานการเพิ่มประจุ (E_c) ซึ่งเป็นพลังงานศักย์ที่ถูกควบคุม โดยแรงดันไฟฟ้าที่ให้จากขั้วเกต ($E_c \propto V_g$) ในขณะที่พลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนแปรผันตรงกับอุณหภูมิ ($E_k \propto k_B T$) แต่แปรผันกับขนาดของแกะ d ดังเส้นชุดในรูปที่ 3 ($E_k \propto d^{-1}$) สภาวะที่พลังงานจลน์มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมของกล่องอิเล็กตรอนเดียว แบ่งได้ 2 กรณีดังนี้



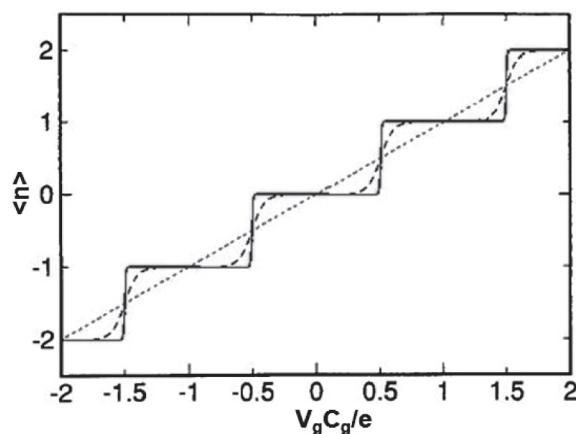
รูปที่ 3 การเปรียบเทียบพลังงานการเพิ่มอิเล็กตรอนเข้าไปในแกะที่มีขนาดต่างๆ เมื่อพลังงานการเพิ่ม ประจุถูกแทนด้วย E_c (เส้นประ) พลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนในแกะแทนด้วย E_k (เส้นชุด) ดังนั้น พลังงานรวมสุทธิของอิเล็กตรอนที่ถูกเพิ่มเข้าไปในระบบ (เส้นทึบ) $E_a = E_c + E_k$ [1]

- กรณีที่ระบบมีอุณหภูมิสูง ในสภาวะนี้พลังงานความร้อนจะทำให้พลังงานจลน์ของอิเล็กตรอน มีค่ามากกว่าพลังงานการเพิ่มประจุ ($E_k = k_B T > E_c$) ในกรณีนี้แรงดันไฟฟ้าภายนอกจะไม่สามารถควบคุมการ เพิ่ม / ลดจำนวนอิเล็กตรอนภายในแกะได้ เนื่องจากพลังงานรวมของอิเล็กตรอนจะมีค่ามากกว่าพลังงานการ เพิ่มประจุ ทำให้อิเล็กตรอนมีพลังงานมากพอที่จะเคลื่อนที่เข้า / ออกจากแกะได้อย่างอิสระ ในสภาวะนี้ จึงไม่สามารถสังเกตพบปรากฏการณ์การขัดขวางแบบคูลอมบ์ได้ [11] ลักษณะการไฟอิเล็กตรอนเฉลี่ย ($\langle n \rangle$) มีลักษณะเป็นกราฟที่ต่อเนื่องเหมือนตัวต้านทานแบบปกติ (common resistors) แต่ในสภาวะที่ระบบมี อุณหภูมิต่ำ พลังงานจลน์จะมีค่าน้อย พลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นจึงไม่เพียงพอที่จะทำให้พลังงานรวมของ อิเล็กตรอนมีค่ามากกว่าพลังงานการเพิ่มประจุ พฤติกรรมของกล่องอิเล็กตรอนเดียวจึงสามารถถูกควบคุม ด้วยแรงดันไฟฟ้าภายนอก โดยการเพิ่ม / ลดแรงดันไฟฟ้าดังกล่าวอย่างเหมาะสม จะทำให้ค่าประจุไฟฟ้าของ

เพิ่ม / ลดเป็นจำนวนท่าของอิเล็กตรอน ปรากฏการณ์การขัดขวางแบบคูลอมบ์ที่เกิดขึ้นในสภาวะเช่นนี้ ทำให้กราฟอิเล็กตรอนเฉลี่ยจะมีลักษณะเป็นขั้นบันได (ไม่ต่อเนื่อง)

รูปที่ 4 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วเกตกับค่าเฉลี่ยของจำนวนอิเล็กตรอน ส่วนเกินในเกะ โดยเส้นที่บึ้งชึ้นเป็นกราฟที่อุณหภูมิภายในระบบต่ำ ดังนั้น เมื่อต้องการให้อิเล็กตรอนเข้าไป ที่การจะต้องให้พลังงานกับอิเล็กตรอนอย่างน้อยเท่ากับพลังงานการเพิ่มประจุ อิเล็กตรอนจึงจะสามารถทะลุผ่านรอยต่อการทะลุผ่านเข้าไปยังเกะได้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่ออิเล็กตรอนตัวที่ 1 เข้าไปในเกะ อิเล็กตรอนตัวที่ 2 จะไม่สามารถเข้าไปในเกะได้ เนื่องจากอิเล็กตรอนที่เข้าไปในเกะจะมีอันตรกิริยาทางไฟฟ้ากับอิเล็กตรอนที่อยู่ภายนอกเกะ ทำให้เกิดการขัดขวางอิเล็กตรอนที่อยู่ภายนอกเนื่องจากแรงคูลอมบ์ (Coulomb force) [12] ในสภาวะที่แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วเกตเป็นลบจะทำให้ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนภายในเกะลดลง อิเล็กตรอนจากภายนอกจึงสามารถทะลุผ่านเข้ามาภายในเกะทำให้จำนวนอิเล็กตรอนส่วนเกินเป็นลบ ในขณะที่เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วเกตเป็นบวกจะทำให้ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในเกะเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนภายในเกะจึงทะลุผ่านรอยต่อการทะลุผ่านออกไปนอกเกะทำให้จำนวนอิเล็กตรอนล่วงเกินภายในเกะเป็นบวก

กรณีเส้นประเป็นกรณีที่ระบบมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ทำให้พลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนเกิดการกวัดแก้วงเพิ่มขึ้นจากการกวัดแก้วงทางความร้อน (Thermal fluctuation) ดังนั้น พลังงานรวมของอิเล็กตรอนภายในระบบจึงมีความแปรปรวนสูง ทำให้ได้กราฟที่มีลักษณะเป็นขั้นบันไดที่ไม่คมเหมือนกราฟที่สภาวะอุณหภูมิต่ำ หากอุณหภูมิของระบบเพิ่มขึ้นจนกระทั่งพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนมีค่ามากกว่าพลังงานการเพิ่มประจุ จะทำให้กราฟมีลักษณะเป็นเส้นตรง



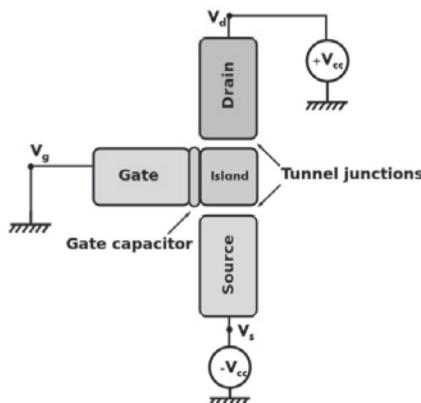
รูปที่ 4 ความสัมพันธ์แบบขั้นบันไดของแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วเกต $V_g = Q/C_g$ กับจำนวนอิเล็กตรอนเฉลี่ยของกล่องอิเล็กตรอนเดี่ยว เมื่อ (เส้นจุด) $T = 27.5$ K, (เส้นประ) $T = 2.75$ K และ (เส้นทึบ) $T = 2.75$ K [5]

2. กรณีที่ภาวะมีขนาดเล็ก ประกอบกับกล่องอิเล็กตรอนเดี่ยวทำงานในย่านอุณหภูมิต่ำ ทำให้ระยะเฉลี่ยเสรีปลดการชน (Mean free path, λ) มีค่ามาก ดังนั้น เมื่อภาวะมีขนาดในระดับเดี่ยว กับระยะตั้งกล่าว อิเล็กตรอนบางส่วนจะสามารถเคลื่อนที่ไปถึงรอยต่อการทะลุผ่านได้โดยปราศจากการชน อย่างไรก็ตาม อิเล็กตรอนจะได้รับพลังงานความร้อนเป็นไปตามฟังก์ชันการกระจายตัวของแม็กเวล (Maxwell distribution function) [13] โดยอิเล็กตรอนจะได้รับพลังงานในช่วง 0 eV ถึง อนันต์ ภายใต้สภาวะที่อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ไปยังรอยต่อการทะลุผ่านได้โดยปราศจากการชน จึงทำให้ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนภายในแกะ อิเล็กตรอนแต่ละตัวจึงครอบครองพลังงานจนที่แตกต่างกัน ในสภาวะนี้อิเล็กตรอนภายในแกะจะมีพลังงานจนไม่ต่อเนื่อง [14] โดยฟังก์ชันการกระจายตัวของแม็กเวลแสดงให้เห็นว่า อิเล็กตรอนบางส่วนจะมีค่าพลังงานจนสูงกว่าค่าพลังงานการเพิ่มประจุ ($k_B T >> E_C$) (แม้ว่าค่าพลังงานความร้อนเฉลี่ยจะมีค่าต่ำกว่าค่าพลังงานการเพิ่มประจุมาก) ดังนั้น เมื่ออิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงเหล่านี้เคลื่อนที่ลงรอยต่อการทะลุผ่าน จะสามารถทะลุผ่านรอยต่อตั้งกล่าวออกจากแกะไปได้ โดยไม่ต้องอาศัยพลังงานจากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าภายนอก ในสภาวะนี้ อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่เข้า/ออกจากแกะแบบสุ่ม จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เข้า/ออกจากแกะได้ กล่องอิเล็กตรอนเดี่ยวจึงสูญเสียความสามารถในการควบคุมอิเล็กตรอนที่ลະ 1 ตัว

ในกรณีที่ภาวะมีขนาดใหญ่ อิเล็กตรอนภายในแกะจะเกิดการชนแบบยืดหยุ่น (Elastic collision) [15] หล่ายครั้งในระหว่างการเคลื่อนที่ไปยังรอยต่อการทะลุผ่าน อิเล็กตรอนในสภาวะนี้จึงเกิดการแลกเปลี่ยนพลังงานในระหว่างการเคลื่อนที่และทำให้มีค่าพลังงานจนแบบต่อเนื่องเท่ากับค่าเฉลี่ยของพลังงานความร้อนเฉลี่ย ($k_B T$) ดังนั้น อิเล็กตรอนที่ไปถึงรอยต่อการทะลุผ่านจึงมีค่าพลังงานรวมไม่เพียงพอที่จะทะลุผ่านรอยต่อ ในการเคลื่อนที่เข้า/ออกจากแกะของอิเล็กตรอนจึงจำเป็นต้องได้รับพลังงานจากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าภายนอก ในสภาวะนี้ จึงสามารถควบคุมอิเล็กตรอนให้เคลื่อนที่ได้ที่ลະ 1 ตัว จากรูปในรูปที่ 3 ขนาดของแกะที่เล็กที่สุดที่ทำให้พลังงานจนของอิเล็กตรอนไม่ส่งผลต่อปรากฏการณ์ขัดขวางแบบคูลอมบ์มีขนาดประมาณ 10 nm

ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยว

จากโครงสร้างของกล่องอิเล็กตรอนเดี่ยวในหัวข้อที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่ลະ 1 ตัว แต่อย่างไรก็ตาม โครงสร้างดังกล่าวยังมีข้อจำกัดในการนำเอาอิเล็กตรอนที่เก็บไว้ภายในกล่องอิเล็กตรอนเดี่ยวไปใช้งานจริง เนื่องจากใช้รอยต่อการทะลุผ่านเพียงรอยต่อเดียวเป็นทางเข้าและทางออกของอิเล็กตรอน ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดที่จะปรับโครงสร้างทางกายภาพของกล่องอิเล็กตรอนเดี่ยวให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนให้ผ่านแกะที่ลະ 1 ตัว ซึ่งสามารถทำได้โดยการเพิ่มรอยต่อการทะลุผ่านอีก 1 รอยต่อ ทำให้ได้โครงสร้างของแกะที่มีทางเข้าและทางออกของอิเล็กตรอนแยกจากกันดังรูปที่ 5 โครงสร้างที่ได้ประกอบด้วยแกะ 1 แกะ ที่ถูกเชื่อมโยงกับภายนอกผ่านทางชั้นชอร์ส (Source) ชั้นเดрен (Drain) และชั้นเกต โดยร้อยต่อระหว่างแกะกับชั้นชอร์ส และชั้นเดренเป็นรอยต่อการทะลุผ่าน ในขณะที่รอยต่อระหว่างแกะกับชั้นเกตเป็นรอยต่อตัวเก็บประจุ ซึ่งมีกำแพงคั้นอยู่และหนาพอที่จะกักอิเล็กตรอนไม่ให้รั่วผ่านชั้นเกตออกจากแกะ อุปกรณ์อิเล็กตรอนเดี่ยวที่มีโครงสร้างลักษณะนี้ เรียกว่า ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยว [16]



รูปที่ 5 ตัวอย่างวงจรของทรานซิสเตอร์อิเล็กtrononเดี่ยวที่ประกอบด้วยรอยต่อการทะลุผ่าน 2 รอยต่อ รอยต่อตัวเก็บประจุ เกาะ ขั้วชอร์ส ขั้วเดرنและขั้วเกต

รอยต่อการทะลุผ่านทั้ง 2 รอยต่อ ภายในโครงสร้างทรานซิสเตอร์อิเล็กtrononเดี่ยวไม่สามารถกักอิเล็กtrononที่จะทะลุผ่านได้ ดังนั้น ในการควบคุมให้อิเล็กtrononไหลผ่านเกะทีลະ 1 ตัว จึงต้องอาศัยการได้แรงดันไฟฟ้าจากภายนอกเข้าที่ขั้วเกต ขั้วเดرنและขั้วชอร์ส จากนั้นในการควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กtrononให้ผ่านจากขั้วชอร์สไปยังเกะ และออกจากเกะไปยังขั้วเดرنทีลະ 1 ตัว จำเป็นต้องได้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วเกตและขั้วเดรนให้มีขนาดและจังหวะที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดปรากฏการณ์การขัดขวางแบบคูลอมบ์ขึ้นภายในเกะซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กtrononผ่านเกะได้ทีลະ 1 ตัว โดยลักษณะการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้น อิเล็กtrononจะเคลื่อนที่ออกจากขั้วชอร์สไปยังเกะ ในขณะที่ขั้วเดรนจะทำหน้าที่รับอิเล็กtrononจากเกะ และใช้การเชื่อมโยงด้วยสนามไฟฟ้าจากขั้วเกตในการควบคุมจังหวะการไหลของอิเล็กtronon ทำให้อุปกรณ์ที่ได้มีลักษณะการทำงานคล้ายกับทรานซิสเตอร์แบบดั้งเดิมที่ใช้สนามไฟฟ้าในการควบคุมการไหลของอิเล็กtrononจากขั้วชอร์สไปยังขั้วเดรน อย่างไรก็ตาม ข้อแตกต่างสำคัญ คือทรานซิสเตอร์อิเล็กtrononเดี่ยวสามารถควบคุมอิเล็กtrononได้ทีลະ 1 ตัว ทำให้ทรานซิสเตอร์อิเล็กtrononเดี่ยวใช้พลังงานต่ำกว่าทรานซิสเตอร์แบบดั้งเดิมมาก นอกจากนี้ ความสามารถในการควบคุมอิเล็กtrononทีลະ 1 ตัว ทำให้ทรานซิสเตอร์อิเล็กtrononเดี่ยวมีความไวในการตอบสนองต่อปริมาณทางกายภาพต่างๆ สูงกว่าทรานซิสเตอร์แบบดั้งเดิมมาก

ทรานซิสเตอร์อิเล็กtrononเดี่ยวโดยทั่วไปกำหนดการเคลื่อนที่ของอิเล็กtrononให้เคลื่อนที่จากขั้วชอร์สไปยังขั้วเดรน โดยการให้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วไฟฟ้าทั้ง 3 ขั้ว คือ ขั้วเกต ขั้วชอร์สและขั้วเดรน ทำให้อิเล็กtrononที่ส่วนต่างๆ ของทรานซิสเตอร์อิเล็กtrononเดี่ยวมีระดับพลังงานแตกต่างกัน จำกโครงสร้างดังที่กล่าวไว้ข้างต้นในรูปที่ 5 รอยต่อที่ขั้วเกตเป็นรอยต่อที่มีความกว้างที่อิเล็กtrononไม่สามารถทะลุผ่านได้ แต่ระดับพลังงานของอิเล็กtrononภายใต้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วต่างๆ ดังรูปที่ 5 จะทำให้คักไฟฟ้าที่ขั้วเดรนเป็นคักยับกวนและคักไฟฟ้าที่ขั้วชอร์สเป็นคักย์ลับเมื่อเทียบกับคักไฟฟ้าอ้างอิง (Ground) ที่ขั้วเกต เมื่อวัดลักษณะสมบัติจะได้แผนภาพที่แสดงการควบคุมอิเล็กtrononดังรูปที่ 6 ซึ่งเป็นกราฟลักษณะสมบัติของทรานซิสเตอร์อิเล็กtronon

เดียวที่อุณหภูมิต่ำ ($k_B T = 0.1 E_C$) และการเมื่อนำไฟฟ้าเพียงพอที่จะละเลียดของความไม่ต่อเนื่องของพลังงานลงนี้ ดังนั้น พลังงานรวมของอิเล็กตรอนจึงประมวลเท่ากับค่าพลังงานการเพิ่มประจุ จากราฟลักษณะสมบัติในรูปที่ 6 สามารถแบ่งการทำงานของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดียวออกเป็น 4 ช่วงการทำงาน [16] คือ

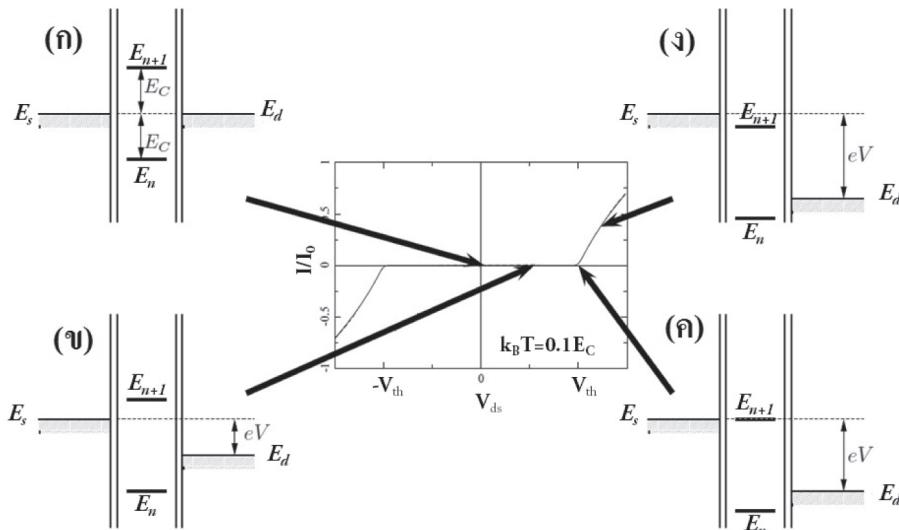
1. ในสภาวะที่แรงดันไฟฟ้าทั้ง 3 ขั้ว มีค่าเท่ากัน ($V_s = V_d = V_g = 0$) แม้ว่าอยู่ต่อการทะลุผ่านทั้ง 2 รอยต่อระหว่างขั้วซอร์สและขั้วเดренจะไม่สามารถหยุดการไหลของอิเล็กตรอนได้ แต่ในโครงสร้างที่มีเก้าคันกลางระหว่างขั้วทั้งสองจะทำให้อิเล็กตรอนไม่สามารถทะลุผ่านรอยต่อได้ เมื่อจากขั้วทั้งสองมีระยำห่างมาก ทำให้อิเล็กตรอนไม่สามารถทะลุผ่านจากขั้วซอร์สไปยังขั้วเดренได้โดยตรง จึงจำเป็นต้องเกิดการทะลุผ่านจากขั้วซอร์สไปยังเก้าและจากเก้าไปยังขั้วเดрен แต่อย่างไรก็ตาม ในสภาวะนี้ไม่มีระดับพลังงานว่างภายในเก้าที่อิเล็กตรอนจากภายนอกจะสามารถครอบครองได้ เพราะระดับพลังงานห่าง E_{n+1} ที่มีภายในเก้ามีพลังงานสูงกว่าอิเล็กตรอนที่อยู่นอกเก้าประมวล E_C ดังนั้น อิเล็กตรอนภายนอกเก้าจึงมีพลังงานไม่เพียงพอที่จะทะลุผ่านรอยต่อไปยังเก้าได้ ทำให้มีเกิดกระแสไฟฟ้าในระบบ ดังรูปที่ 6 (ก)

2. ในสภาวะที่แรงดันไฟฟ้าที่ต่อกคร่อมขั้วเดренและขั้วซอร์สเพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่าแรงดันไฟฟ้าขีดเริ่ม (Threshold voltage) ($0 < V_{ds} < V_{th}$) ซึ่งแรงดันไฟฟ้าที่ต่อกคร่อมขั้วเกตและขั้วซอร์ส (V_{gs}) จะเพิ่มขึ้น ทำให้ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนที่ขั้วซอร์สเพิ่มขึ้น แต่พลังงานของอิเล็กตรอนภายในเก้าและที่ขั้วเดренลดลง แต่อิเล็กตรอนที่ขั้วซอร์สมีพลังงานรวมน้อยกว่าระดับพลังงานว่างภายในเก้า ($E < E_{n+1}$) เมื่อจากพลังงานที่ให้อิเล็กตรอนที่ขั้วซอร์สน้อยกว่าพลังงานที่ต้องใช้ในการเพิ่มประจุ (E_C) อิเล็กตรอนที่ขั้วซอร์สจึงมีพลังงานรวมไม่เพียงพอที่จะทะลุผ่านไปยังเก้าได้ดังแผนภาพในรูปที่ 6 (ข) ซึ่งในช่วงการทำงานนี้กระแสจะไม่สามารถไหลผ่านทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดียวໄວได้ ($I/I_0 = 0$) เมื่อค่า I_0 คือกระแสของอิเล็กตรอน 1 ตัวที่ไหลผ่านรอยต่อการทะลุผ่านมีค่าเท่ากับ $e/R_t C_t$ [17]

3. ในสภาวะที่แรงดันไฟฟ้าที่ต่อกคร่อมขั้วเดренและขั้วซอร์สเท่ากับแรงดันไฟฟ้าขีดเริ่ม ($V_{ds} = V_{th}$) จะทำให้ $V_{gs} = e/2C_\Sigma$ พลังงานของอิเล็กตรอนที่ขั้วซอร์สจึงมีพลังงานเท่ากับระดับพลังงานว่างของเก้า ($E_s = E_{n+1}$) ดังรูปที่ 6 (ค) ในสภาวะนี้ อิเล็กตรอนที่ขั้วซอร์สจะสามารถทะลุผ่านรอยต่อไปครอบครองระดับพลังงานว่างของเก้าได้ การจ่ายแรงดันไฟฟ้าลักษณะนี้จะทำให้ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนที่ขั้วเดренต่ำกว่าที่ขั้วซอร์สและเก้า อย่างไรก็ตาม อิเล็กตรอนจากเก้าจะยังไม่สามารถทะลุมาถึงขั้วเด-renได้ เมื่อจากเมื่ออิเล็กตรอนเข้าไปยังเก้า ทำให้อิเล็กตรอนในระดับพลังงาน E_{n+1} จะมีพลังงานเพิ่มขึ้น ในขณะที่ระดับพลังงานที่ขั้วซอร์สคงที่ อิเล็กตรอนดังกล่าวจึงไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านไปยังรอยต่อการทะลุผ่านระหว่างเก้ากับขั้วเดренได้ แต่จะทะลุกลับไปมาระหว่างขั้วซอร์สกับเก้า ดังนั้น การจ่ายแรงดันไฟฟ้าในลักษณะนี้จะทำให้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยของอิเล็กตรอนที่ไหลผ่านทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดียวเป็นศูนย์

4. ในสภาวะที่ แรงดันไฟฟ้าที่ต่อกคร่อมขั้วเดренและขั้วซอร์สมากกว่าแรงดันไฟฟ้าขีดเริ่ม ($V_{ds} > V_{th}$) จะทำให้ $V_{gs} > e/2C_\Sigma$ อิเล็กตรอนที่ขั้วซอร์สจึงมีพลังงานมากกว่าระดับพลังงานว่างภายในเก้า ($E_s > E_{n+1}$) ส่งผลให้อิเล็กตรอนสามารถทะลุผ่านรอยต่อจากขั้วซอร์สไปยังเก้าและจากเก้าทะลุไปยังขั้วเด-renได้ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าผ่านทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดียวໄວ ($I/I_0 \neq 0$) ซึ่งกระแสที่เกิดขึ้นเป็นผลจากปรากฏการณ์การทะลุผ่าน ประกอบกับภายในเก้ามีระดับพลังงานว่างที่สามารถให้อิเล็กตรอนจากภายนอกเข้าไปครอบครองได้เพียง 1 ตัวเท่านั้น ทำให้การไหลของกระแสในทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดียวเป็นกระแสของ

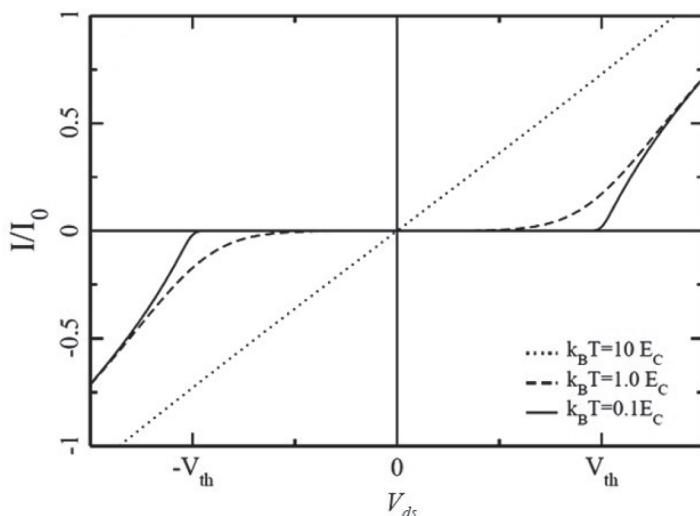
อิเล็กตรอนเพียง 1 ตัว เมื่ออิเล็กตรอนตัวที่ 1 เข้าไปในแกะ อิเล็กตรอนตัวที่ 2 จะยังไม่สามารถเข้าไปภายในแกะได้จนกว่าอิเล็กตรอนตัวที่ 1 จะทะลุผ่านไปยังชั้วเดรน อิเล็กตรอนตัวที่ 2 จึงจะสามารถเข้าไปภายในแกะได้ ซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์การขัดขวางแบบคูลอมบ์ ลักษณะการทำงานดังกล่าวทำให้ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนภายในระบบได้ทีละ 1 ตัว ดังรูปที่ 6 (ง)



รูปที่ 6 แผนภาพการควบคุมอิเล็กตรอนของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวเมื่อมีการปรับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ตกลงร่วมระหว่างชั้วซอร์สและชั้วเดรน (ก) สภาวะที่ไม่มีการจ่ายแรงดันไฟฟ้า ($V_s = V_d = V_g = 0$) (ข) สภาวะที่จ่ายแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่าแรงดันไฟฟ้าขีดเริ่ม ($0 < V_{ds} < V_{th}$) (ค) สภาวะที่จ่ายแรงดันไฟฟ้าที่เท่ากับแรงดันไฟฟ้าขีดเริ่ม ($V_{ds} = V_{th}$) (ง) สภาวะที่จ่ายแรงดันไฟฟามากกว่าแรงดันไฟฟ้าขีดเริ่ม ($V_{ds} > V_{th}$) ซึ่งทำให้เกิดกระแสไฟหล่อผ่านทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยว [16]

จากหลักการทำงานของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวที่ได้กล่าวมา แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ปรากฏการณ์การขัดขวางแบบคูลอมบ์ในการควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนทีละ 1 ตัว ภายในทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยว กระแสที่วัดได้จากทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวจึงแตกต่างจากกระแสที่ไฟหล่อผ่านทรานซิสเตอร์แบบตั้งเดิม และไม่เป็นไปตามกฎของโอมห์ (Ohm's law) กล่าวคือ กระแสที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นขั้นบันไดที่ไม่ต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์การขัดขวางแบบคูลอมบ์จะถูกทำลายลงด้วยผลกระทบจากการกวัดแก่งทางความร้อน กล่าวคือ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ความแตกต่างระหว่างพลังงานรวมของอิเล็กตรอนภายในออกอากาศและระดับพลังงานว่างภายในแกะจะลดลง ทำให้อุณหภูมิของกระแสไฟหล่อผ่านจากชั้วซอร์สไปยังแกะเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้เกิดกระแสรั่วในสภาวะที่ $V_{ds} < V_{th}$ ดังรูปที่ 7 เมื่อ $k_B T = 1.0 E_C$ กระแสจะสามารถหล่อผ่านทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวได้ เมื่อ $V_{ds} = V_{th}/2$ และกระแสเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อ $V_{ds} > V_{th}$ อย่างไรก็ตาม เมื่อระบบทำงานที่อุณหภูมิสูง ($k_B T \gg E_C$) พลังงานรวมของอิเล็กตรอนภายใน

ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวจะมีค่ามาก ทำให้อิเล็กตรอนภายในเก้าไม่สามารถแสดงปรากฏการณ์การขัดขวางแบบคูลอมบ์ได้ ภาพลักษณะสมบัติของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวจึงมีลักษณะเหมือนกับของทรานซิสเตอร์แบบปกติ โดยภาพลักษณะสมบัติของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวในรูปที่ 7 จะถูกรเข้าและกล้ายเป็นกราฟเส้นตรง เมื่อ $k_B T = 10 E_C$



รูปที่ 7 ผลของอุณหภูมิต่อปรากฏการณ์การขัดขวางแบบคูลอมบ์ที่เกิดขึ้นในทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยว โดยแสดงได้จากค่ากระแสที่ไหลระหว่างขั้วเดренและขั้วซอร์ส [16]

จากลักษณะสมบัติของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวที่กล่าวมาข้างต้น กระแสจะสามารถไหลผ่านจากขั้วเดренไปยังขั้วซอร์สได้ เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วเกตมีค่ามากกว่าแรงดันไฟฟ้าขีดเริ่ม ซึ่งในสภาวะนี้ ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวจะอยู่ในโหมดการทำงานแบบสวิตช์อ่อน (Switch on) ในขณะที่กระแสไฟฟ้าจะไม่สามารถไหลผ่านทรานซิสเตอร์ได้ เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วเกตมีค่าน้อยกว่าแรงดันไฟฟ้าขีดเริ่ม เรียกโหมดการทำงานนี้ว่า สวิตช์อฟ (Switch off) ดังนั้น อุปกรณ์อิเล็กตรอนเดี่ยวลักษณะนี้จึงมีโหมดการทำงานคล้ายกับทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าชนิดเงิน (*n*-type MOSFET) ซึ่งใช้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วเกตในการควบคุมการไหลของกระแสจากขั้วเดренไปขั้วซอร์ส

การประยุกต์ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยว

อุปกรณ์อิเล็กตรอนเดี่ยวที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงต้องมีรอยต่อสำหรับอิเล็กตรอนเข้าและออกแยกจากกัน ดังนั้น จึงต้องประกอบด้วยรอยต่อการหลุดผ่านอย่างน้อย 2 รอยต่อ ซึ่งจะทำให้สามารถวัดการตอบสนองทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กตรอนเดี่ยวต่อบริมาณต่างๆ ได้ โครงสร้างที่ง่ายที่สุดของอุปกรณ์อิเล็กตรอนเดี่ยวที่สามารถวัดบริมาณทางไฟฟ้าได้ประกอบด้วยรอยต่อการหลุดผ่าน 2 รอยต่อ ได้แก่ ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยว ในยุคแรก การสร้างทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวจะประสบปัญหาใน

การปลูกภาวะและชั้นจนวนในระดับนาโนเมตร แต่เทคโนโลยีปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้สามารถปลูกฟิล์มคุณภาพสูงในระดับนาโนเมตรได้ ดังนั้น ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดียว ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้ถูกศึกษา พัฒนา และวิจัยอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กตรอนเดียวที่มีรอยต่อการหล่อผ่าน 3 รอยต่อ ขึ้นไป แม้จะสามารถสร้างได้หลายโครงสร้าง โดยแต่ละโครงสร้างต่างมีจุดเด่นที่น่าสนใจแตกต่างกัน แต่อุปกรณ์เหล่านี้ยังประสบปัญหานในการสร้างช้าให้อุปกรณ์ทุกตัวมีคุณสมบัติเหมือนกัน (Reproducible fabrication) [18] ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการผลิตในเชิงพาณิชย์ ทำให้มิได้รับความนิยมในการศึกษาวิจัย

ในปัจจุบัน อุปกรณ์อิเล็กตรอนเดียวต่างๆ รวมถึงทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดียวแม้ไม่มีการผลิตในเชิงพาณิชย์ แต่มีการวิจัยและพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้งานของอุปกรณ์เหล่านี้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ถูกคาดหวังว่าจะสามารถแก้ไขขีดจำกัดต่างๆ ของอุปกรณ์อิเล็กตรอนนิกส์ที่ใช้งานในปัจจุบัน ประกอบกับทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดียวเป็นอุปกรณ์ที่มีศักยภาพสูงในการผลิตขายในเชิงพาณิชย์ ฉะนั้น ในบทความนี้จะเน้นการนำทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดียวไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ โดยลักษณะเด่นของอุปกรณ์อิเล็กตรอนเดียวชนิดนี้ คือ การใช้พลังงานในการทำงานต่ำ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปสร้างอุปกรณ์ที่มีความไวสูงในการตอบสนองต่อปริมาณทางกายภาพต่างๆ รวมถึงศักยภาพในการประยุกต์ใช้สร้างวงจรตระกูล (Logic circuits) ต่างๆ แต่ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดียวมีข้อจำกัดสำคัญ คือ ต้องทำงานในช่วงอุณหภูมิต่ำ [19, 20] เพื่อให้อุปกรณ์สามารถแสดงปรากฏการณ์การขัดขวางแบบคูลอมบ์ได้

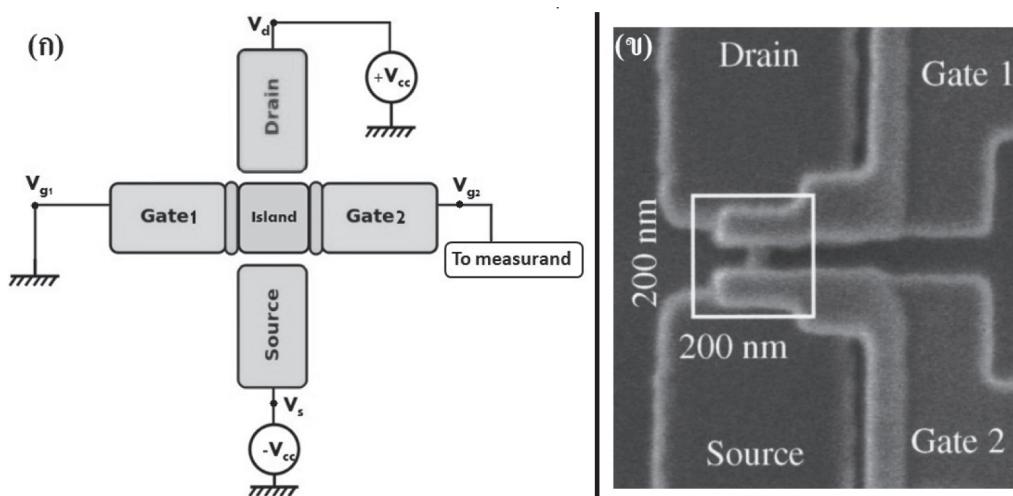
1. เช่นเชื้อความไวสูง

จากโครงสร้างและหลักการทำงานของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดียวในรูปที่ 6 แสดงให้เห็นว่า อุปกรณ์ชนิดนี้มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงค่าสนามไฟฟ้าที่ขั้วเกต การเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุในระดับที่น้อยกว่า 1 ประจุอิเล็กตรอน [1] ($e = 1.6 \times 10^{-19}$ C) จะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อปริมาณการไหลของกระแสที่ไหลระหว่างขั้วชอร์สและขั้วเดรน ทำให้เกิดแนวคิดที่จะประยุกต์ใช้ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดียวในการวัดสนามไฟฟ้าขนาดเล็ก รวมถึงการวัดประจุในระดับ 1 ประจุอิเล็กตรอน อุปกรณ์ที่ใช้โครงสร้างทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดียวในการวัดลักษณะนี้ เรียกว่า ชุปเปอร์เซนซิฟิอิเล็กทรอมิเตอร์ [1]

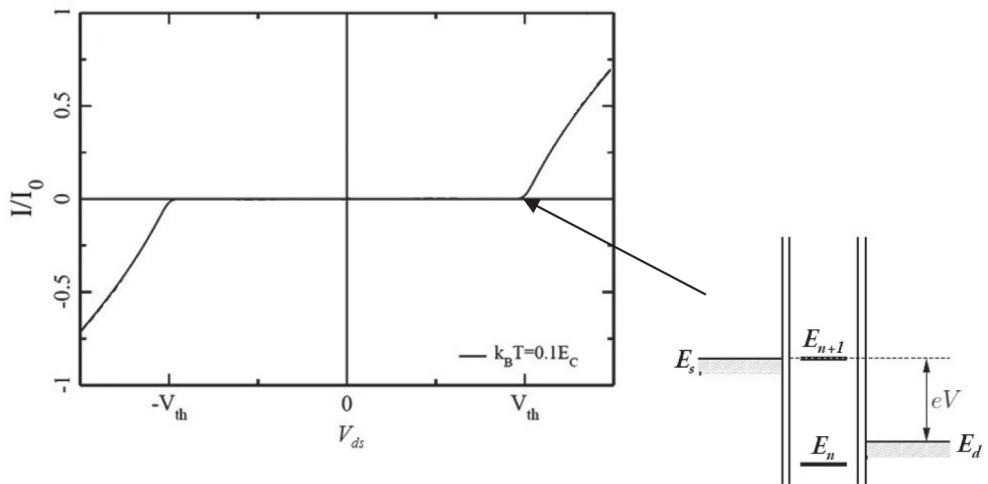
การประยุกต์ใช้งานทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดียวให้มีความไวในการตอบสนองต่อสนามไฟฟ้า หรือประจุไฟฟ้าจากภายนอก สามารถทำได้โดยการเพิ่มขั้วเกตของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดียวเป็น 2 ขั้ว โดยทั้ง 2 ขั้วจะเชื่อมโยงเข้ากับเค้าผ่านรอยต่อตัวเก็บประจุ [21] เพื่อไม่ให้ประจุภายในเคาร์ว์ออกจากเค้าผ่านไปยังขั้วเกตทั้ง 2 ขั้วได้ดังรูปที่ 8 (ก) ขั้วเกตที่ 1 จะต่อเข้ากับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าจากภายนอก เพื่อทำหน้าที่กำหนดจุดทำงานของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดียว ในขณะที่ขั้วเกตที่ 2 จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์หรือวิเคราะห์ที่ต้องการวัดค่าสนามไฟฟ้าหรือประจุไฟฟ้า

การทำงานของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดียวที่มีโครงสร้างลักษณะดังกล่าว มีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกับทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดียวทั่วไป อิเล็กตรอนที่ไหลผ่านจากขั้วชอร์สไปยังขั้วเดรน จะถูกควบคุมด้วยสนามไฟฟ้าที่เชื่อมโยงมาจากขั้วเกตทั้ง 2 ขั้ว โดยปกติ แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วเกตที่ 1 จะถูกใช้กำหนดค่าระดับพลังงานว่างของอิเล็กตรอนภายในเค้า ซึ่งจะถูกกำหนดให้มีค่าคงที่ (V_{g1}) ในขณะที่แรงดัน

ไฟฟ้าที่ตกคร่อมขั้วชอร์สและขั้วเดรนจะถูกกำหนดให้มีค่าประมาณแรงดันไฟฟ้าขีดเริ่ม ($V_{ds} \approx V_{th}$) ในสภาวะนี้ อิเล็กตรอนที่ขั้วชอร์สของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวจะอยู่ในสภาวะที่พร้อมจะทะลุผ่านเก้าะไปยังขั้วเดรน เนื่องจากระดับพลังงานรวมของอิเล็กตรอนที่ขั้วชอร์สมีค่าเท่ากับระดับพลังงานว่างกายในเก้าะ ($E_s = E_{n+1}$) ดังรูปที่ 9 ซึ่งการควบคุมทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวในลักษณะดังกล่าว ทำให้ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าจากภายนอกที่ขั้วเกตที่ 2 (V_{g2}) อย่างมาก เมื่อสนามไฟฟ้าที่ขั้วเกตที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ เมื่อสนามไฟฟ้าที่ขั้วเกตที่ 2 ทำให้ระดับพลังงานว่างกายในเก้าะมีค่าลดลง อิเล็กตรอนจากขั้วชอร์สจะสามารถทะลุเข้าไปในเก้าะและทะลุจากเก้าะไปยังขั้วเดรนได้ ทำให้เกิดการไหลของกระแส แต่เมื่อสนามไฟฟ้าที่ขั้วเกตที่ 2 ทำให้ระดับพลังงานว่างกายในเก้าะมีค่าเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากขั้วชอร์สจะไม่สามารถทะลุเข้าไปยังเก้าะและออกไปยังขั้วเดรนได้ ทำให้ไม่เกิดการไหลของกระแส การเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าที่ส่งผลต่อระดับพลังงานว่างกายในเก้าะให้สูงขึ้นหรือต่ำลงจะทำให้เกิดการไหลหรือหยุดไหลของกระแสที่ผ่านทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวตามจังหวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยการไหลของกระแสดังกล่าวถูกนำไปคำนวณเป็นขนาดของสนามไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือบริเวณที่ต้องเข้ากับขั้วเกต

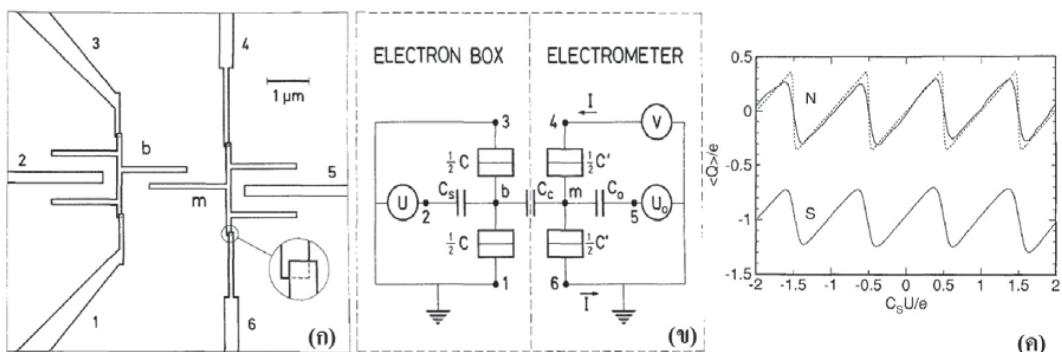


รูปที่ 8 (ก) ชุบเปอร์เซนซิทีฟอิเล็กทรอนิกมิเตอร์ประกอบด้วยรอยต่อการทะลุผ่าน 2 รอยต่อ รอยต่อ ตัวเก็บประจุ เก้าะ ขั้วชอร์ส ขั้วเดรนและขั้วเกต 2 ขั้ว (ข) ภาพถ่ายด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องร้าด (SEM) ของโครงสร้างชุบเปอร์เซนซิทีฟอิเล็กทรอนิกมิเตอร์ [21]



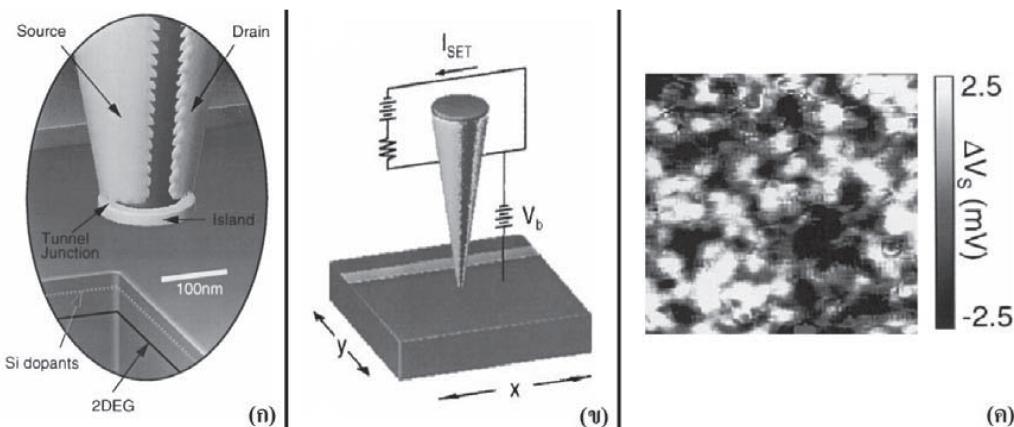
รูปที่ 9 แผนภาพการควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ต่อกรุ่นขั้วซอร์สและขั้วเดรนของชุบเปอร์เซนซิฟอิเล็กทรอมิเตอร์ เพื่อให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมใช้งาน (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง [16])

จากโครงสร้างและหลักการทำงานของชุบเปอร์เซนซิฟอิเล็กทรอมิเตอร์ ทำให้เกิดข้อจำกัดในการประยุกต์ใช้งาน เนื่องจากอุปกรณ์ชนิดนี้มีโครงสร้างในระดับนาโนเมตร ทำให้สามารถวัดสนามไฟฟ้าได้จากพื้นที่ขนาดเล็กเท่านั้น จึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ขนาดใหญ่ได้ ประกอบกับการตอบสนองที่ไวต่อสนามไฟฟ้า ทำให้อุปกรณ์ชนิดนี้สามารถวัดสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุขนาดเล็ก แต่ไม่สามารถวัดสนามขนาดใหญ่ได้ การประยุกต์ใช้งานโดยมากจะเป็นการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์หรือเครื่องมือวัดแบบจุลภาค (Microscopic) เช่น การประยุกต์ใช้ในการวัดปรากฏการณ์การขัดขวางแบบคูลอมบ์ในกล่องอิเล็กตรอนเดียว [5] และการประยุกต์ใช้งานร่วมกับหัววัดของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบล่องกราด [3, 4]



รูปที่ 10 การประยุกต์ใช้ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดียวเป็นชุบเปอร์เซนซิฟอิเล็กทรอมิเตอร์ (ก) โครงสร้างของชุบเปอร์เซนซิฟอิเล็กทรอมิเตอร์ (ข) วงจรสมมูลของโครงสร้างชุบเปอร์เซนซิฟอิเล็กทรอมิเตอร์และ (ค) ผลการวัดประจุในภาวะของกล่องอิเล็กตรอนเดียวด้วยชุบเปอร์เซนซิฟอิเล็กทรอมิเตอร์ [5]

รูปที่ 10 (ก) แสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทรานซิสเตรอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวเป็นชุปเปอร์เซนซิฟิฟอิเล็กทรอมิเตอร์สำหรับวัดประจุที่เปลี่ยนแปลงภายในภาวะของกล่องอิเล็กตรอนเดี่ยวลาฟาร์กและคอนะ (Lafarge et al) [5] ประยุกต์ใช้เทคนิค nano-lithography [22] ร่วมกับชาโดว์อีวีพอเรชัน (Shadow evaporation) [23] ในการสร้างอุปกรณ์อิเล็กตรอนเดี่ยวดังรูปที่ 10 (ข) อุปกรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นนี้ประกอบด้วยทรานซิสเตรอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวที่เหมือนกัน 2 ตัวมาเชื่อมโยงกันผ่านชั้วเกตของเกาะ b และเกาะ m ทำให้เกิดรอยต่อตัวเก็บประจุ (C_C) ระหว่างชั้วเกตดังกล่าว ดังนั้น เมื่ออิเล็กตรอนหลุดผ่านออกไปจากเกาะ b จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าเชื่อมโยงไปยังเกาะ m แล้วส่งผลให้ระดับพังงานว่างภายในเกาะ m ลดลง ทำให้กระแสของชุปเปอร์เซนซิฟิฟอิเล็กทรอมิเตอร์ไหลจากชั้วเดรนไปยังชั้วชอร์ส กระแสที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนประจุภายในเกาะ b ทำให้สามารถคำนวณจำนวนประจุภายในกล่องอิเล็กตรอนเดี่ยวจากกระแสที่ไหลผ่านชุปเปอร์เซนซิฟิฟอิเล็กทรอมิเตอร์ ดังผลที่แสดงในรูปที่ 10 (ค)



รูปที่ 11 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทรานซิสเตรอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวร่วมกับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด [3]

- (ก) หัววัดของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีโครงสร้างของทรานซิสเตรอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวบนปลายหัววัด
- (ข) ลักษณะการจ่ายแรงดันไฟฟ้าจากภายนอกเพื่อควบคุมทรานซิสเตรอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวบนปลายหัววัด
- (ค) ตัวอย่างภาพถ่ายการกระจายตัวของประจุบนชิ้นตัวอย่างสารที่ถูกเจือโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีทรานซิสเตรอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวบนปลายหัววัด จุดมืดแสดงประจุลบในขณะที่จุดสว่างแทนประจุบวก

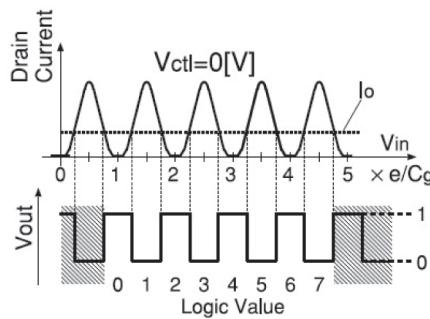
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทรานซิสเตอร์อิเล็กทรอนเดี่ยวร่วมกับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนแบบส่อง粒ดแสดงดังรูปที่ 11 โดยเป็นการสร้างทรานซิสเตอร์อิเล็กทรอนเดี่ยวบนป้ายหัววัด (Probe) เพื่อเพิ่มคักยกภาพในการวัดของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอน เนื่องจากโครงสร้างทางกายภาพของทรานซิสเตอร์อิเล็กทรอนเดี่ยวไม่ซับซ้อน ยู และคงทน (Yoo et al) [3] จึงประยุกต์ใช้เทคนิคการอ้ววapoเรชันในการสร้างชั้นฟิล์มบางอลูมิเนียมลงบนป้ายไยแก้ว (Glass fiber) ทั้งสองข้างเพื่อใช้เป็นขั้วชอร์สและขั้วเดรนดังรูปที่ 11 (ก) จากนั้นเคลือบชั้นจนวนรูปร่างแผ่นจานลงบนป้ายไยแก้ว แล้วเคลือบชั้นฟิล์มบางอลูมิเนียมลงบนชั้นจนวนดังกล่าว ทำให้ได้โครงสร้างของทรานซิสเตอร์อิเล็กทรอนเดี่ยวบนป้ายหัววัดสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอน

หัววัดที่สร้างขึ้นมีขนาดเล็กกว่าศูนย์กลาง 100 นาโนเมตร จึงทำให้สามารถถ่ายภาพพื้นผิวของชั้นสารตัวอย่างได้ด้วยความละเอียดสูง นอกจากรูปที่ 11 (ก) ที่ต้องสนองต่อสถานไฟฟ้าจากภายนอก ทำให้สามารถวัดสถานไฟฟ้าจากประจุที่ผิวและใต้ผิวของชั้นสารตัวอย่างได้ในขณะใช้งาน ขั้วเดรนและขั้วชอร์สจะเชื่อมโยงเข้ากับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าจากภายนอก พร้อมทั้งจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับชั้นสารตัวอย่างดังรูปที่ 11 (ข) เพื่อให้หัววัดที่สร้างขึ้นจะอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน เนื่องจากหัววัดอยู่ใกล้กับพื้นผิวของชั้นสารตัวอย่าง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนที่ใช้หัววัดลักษณะนี้จึงสามารถถ่ายภาพการกระจายตัวของประจุของสารเจือนิวของสารกึ่งตัวนำได้ดังรูปที่ 11 (ค) จุดสว่างในรูปคือตำแหน่งของประจุบวก ในขณะที่จุดมืดคือ ตำแหน่งของประจุลบ

2. เกตตระกูลอิเล็กทรอนเดี่ยว

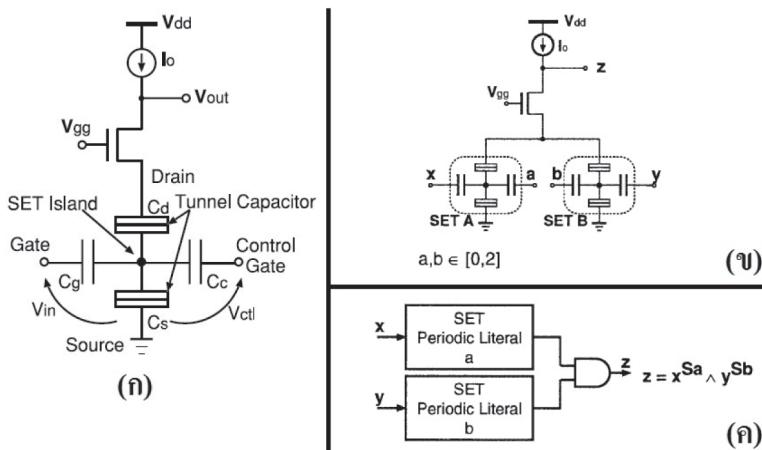
เกตตระกูลอิเล็กทรอนเดี่ยวเป็นเกตตระกูลหลายระดับ (Multi-value logic gates) [6] ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเพิ่มความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์ดิจิตอล (Digital) ในปัจจุบัน เนื่องจาก 1 บิตข้อมูลของเกตตระกูลแบบหลายระดับจะเท่ากับข้อมูลแบบไบนาเรีย (Binary) หลายบิต [12] การใช้เกตชนิดนี้จึงทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลแบบไบนาเรียได้หลายบิตพร้อมกัน ความเร็วในการทำงานจึงเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถจัดการข้อมูลปริมาณมากด้วยความเร็วประมวลผลสูง นับเป็นแนวทางการแก้ปัญหาความเร็วในการตอบสนองของเกตตระกูลแบบไบนาเรียที่ถูกสร้างจากมอสเฟต (MOSFET) ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่ผ่านมาทำได้โดยลดขนาดทางกายภาพของมอสเฟตเพื่อเพิ่มความเร็วในการตอบสนองต่อสัญญาณของเกตตระกูลแบบไบนาเรีย แต่วิธีการเพิ่มความเร็วดังกล่าวนี้ได้ถึงขีดจำกัด เนื่องจากการลดขนาดของมอสเฟตให้เล็กลงกว่าขนาดในปัจจุบันจะทำให้อุปกรณ์แสดงพฤติกรรมทางวงจรแตกต่างจากมอสเฟตปกติ อันเป็นผลจากปรากฏการณ์ทางคุณต้ม

ทรานซิสเตอร์อิเล็กทรอนเดี่ยวมีลักษณะความล้มเหลวระหว่างแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วเกตและกระแสเดรนแบบควบคุมดังรูปที่ 12 ลักษณะสมบัติการส่งผ่าน (Transfer characteristics) ที่เป็นค่าบันทึกทำให้เกิดจุดแย้งที่มีเสถียรภาพ (Stability points) [7] หลายจุด จึงสามารถแบ่งกราฟลักษณะสมบัติของทรานซิสเตอร์อิเล็กทรอนเดี่ยวออกได้หลายช่วง ซึ่งในแต่ละช่วงจะถูกกำหนดให้เป็นระดับตระกูลที่แตกต่างกัน อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นจึงมีระดับตระกูลตั้งแต่ 2 ระดับ ถึง อนันต์ จำนวนระดับตระกูลจะขึ้นกับช่วงของแรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่จ่ายให้ขั้วเกตของทรานซิสเตอร์อิเล็กทรอนเดี่ยว



รูปที่ 12 grafลักษณะสมบัติการส่งผ่านของความล้มเหลวระหว่างแรงดันไฟฟ้าที่ข้าวเกรตและกระแสเดรนที่เกิดขึ้นในเกตตรรภะอิเล็กตรอนเดี่ยวแบบทว้าไป [6]

ลักษณะรายคานใน Grafลักษณะสมบัติของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวเกิดจากการหลุดผ่านของอิเล็กตรอนเดี่ยวจากข้าวชอร์สไปทางและจากเกะไปข้าวเดรน แรงดันไฟฟ้าข้าวอกที่ข้าวเดรนของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวถูกจำกัดให้มีขนาดเล็กเพื่อให้เกิดปรากฏการณ์การขัดขวางแบบคูลอมบ์ ซึ่งจะส่งผลให้กระแสเดรนมีลักษณะเป็นคาน อย่างไรก็ตาม แรงดันข้าวอกขนาดเล็กที่ข้าวเดรนไม่เหมาะสมกับการใช้งานจริง ทำให้ต้องต่อมอสเฟตแบบคาสโคด (Cascode) เพื่อเพิ่มความต้านทานข้าวอกและแรงดันไฟฟ้าข้าวอกให้มีค่าสูงในระดับที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ ลักษณะการต่อมอสเฟต กับข้าวเดรนของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวแสดงดังรูปที่ 13 (ก) ซึ่งเป็นหน่วยวงจรพื้นฐานสำหรับการสร้างเกตตรรภะอิเล็กตรอนเดี่ยวแบบต่างๆ



รูปที่ 13 การประยุกต์ใช้ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวเป็นเกตตรรภะอิเล็กตรอนเดี่ยว (ก) วงสมมูลของเกตตรรภะอิเล็กตรอนเดี่ยวแบบทว้าไป (ข) วงจรสมมูลของเกตตรรภะอิเล็กตรอนเดี่ยวชนิดแอนด์ (ค) วงจรสมมูลเชิงตรรกะของเกตตรรภะอิเล็กตรอนเดี่ยวชนิดแอนด์ [6]

ตัวอย่างเกตตรรอกอิเล็กตรอนเดี่ยวชนิดแอนด์ (AND single-electron logic gates) แสดงดังรูปที่ 13 (ข) เกตตรรอกดังกล่าวสร้างจากทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัว ต่อขนาดกันเพื่อสร้างขั้วขาเข้า 2 ขั้ว สำหรับใช้ดำเนินการทางตรรกะแบบแอนด์ ซึ่งแผนภาพวงจรสมมูลเชิงตรรกะแสดงดังรูปที่ 13 (ค) เกตชนิดนี้จะช่วยลดความซับซ้อนของวงจรตรรกะ เนื่องจากการทำงาน 1 บิต ของเกตชนิดนี้จะเสื่อมเป็นการทำงานของเกตแบบใบหน้าเรียบร้อยพร้อมกัน จึงทำให้จำนวนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการสร้างวงจรลดลง

เกตตรรอกอิเล็กตรอนเดี่ยวสามารถลดกำลังงานไฟฟ้าและความซับซ้อนของวงจร ในขณะที่ความเร็วในการทำงานของวงจรเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างให้ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวทำงานที่อุณหภูมิห้อง (Room temperature) ยังพบอุปสรรคที่ต้องได้รับการศึกษา ประกอบกับปัญหาการสร้างทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวขึ้นให้มีลักษณะสมบัติเหมือนกันยังคงเป็นความท้าทายของการพัฒนาเทคโนโลยีนาโนโลหะ ดังนั้น การศึกษาวิจัยทางด้านเกตตรรอกอิเล็กตรอนเดี่ยวในปัจจุบันนี้ยังเป็นการพัฒนาเชิงหลักการและแนวคิดโดยใช้วงจรสมมูลของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวในการออกแบบ และจำลองผลตอบสนองและสัญญาณขาออกของวงจรเท่านั้น

สรุป

อุปกรณ์อิเล็กตรอนเดี่ยวเป็นอุปกรณ์ที่อาศัยประภูมิการณ์ความไม่ต่อเนื่องของประจุอิเล็กตรอน ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะสามารถตอบในประภูมิการณ์การทะลุผ่านกำแพงคั้นของอิเล็กตรอน ดังนั้น ในการประยุกต์ใช้งานประภูมิการณ์ลักษณะนี้จำเป็นต้องให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อการทะลุผ่านภายใน แต่เชื่อมต่อกับภายนอกด้วยรอยต่อการทะลุผ่าน แล้วรอยต่อตัวเก็บประจุ โครงสร้างลักษณะนี้จะทำให้เกิดระดับพลังงานของอิเล็กตรอนที่ไม่ต่อเนื่องภายในกระแสให้เกิดประภูมิการณ์การขัดขวางแบบคูลอมบ์ ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม อิเล็กตรอนจะถูกควบคุมให้เคลื่อนที่เข้า / ออกที่ละ 1 ตัว อย่างไรก็ตาม กล่องอิเล็กตรอนเดี่ยวไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เพราะอิเล็กตรอนจะถูกกักกันอยู่ภายในเก้าของกล่องอิเล็กตรอนเดี่ยว เพื่อให้สามารถใช้งานอิเล็กตรอนที่ถูกกักอยู่ภายในเก้า จึงต้องเพิ่มรอยต่อการทะลุผ่านสำหรับเป็นทางออกของอิเล็กตรอน โครงสร้างที่ได้เรียกว่า ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยว ซึ่งประกอบด้วยรอยต่อการทะลุผ่าน 2 รอยต่อ และรอยต่อตัวเก็บประจุ 1 รอยต่อ

การควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนภายในทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวทำได้โดยการจ่ายแรงดันไฟฟ้าจากภายนอกผ่านขั้วเกต เพื่อควบคุมระดับพลังงานว่างภายในเก้า การเพิ่มหรือลดระดับพลังงานดังกล่าวอย่างน้อยเท่ากับพลังงานการเพิ่มประจุ จะเป็นการควบคุมให้อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อการทะลุผ่านของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยว การเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานอิเล็กตรอนภายในเก้าเพียงเล็กน้อยจะส่งผลต่อกระแสที่เกิดจากการทะลุผ่านของอิเล็กตรอนเดี่ยวอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวจึงถูกประยุกต์ใช้เป็นมิเตอร์วัดสนามไฟฟ้าที่มีความไวสูงหรือซูเปอร์เซ็นเซอร์ ทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวมีนัยสำคัญในวงจรประยุกต์ที่ต้องมีความไวสูง เช่นในวงจรที่ต้องตรวจจับความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว [12] ดังนั้น จึงมีประสิทธิภาพการทำงานสูงและรวดเร็ว

ทرانซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวเป็นอุปกรณ์ที่มีศักยภาพในการใช้งานที่หลากหลายและใช้พลังงานต่ำ แม้ว่างานทางด้านวัสดุศาสตร์จะก้าวหน้าไปมาก แต่อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีในปัจจุบันยังไม่สามารถผลิต ทرانซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวในเชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากโครงสร้างของทرانซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวมีขนาดเล็ก ทำให้ยังประสบปัญหาการสร้างทرانซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวช้าให้มีคุณสมบัติเหมือนกัน ทุกประการ ประกอบกับอุปกรณ์อิเล็กตรอนเดี่ยวเหล่านี้ยังไม่สามารถใช้งานที่อุณหภูมิห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ [18-20] ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังต้องได้รับการศึกษาวิจัยต่อไป

เอกสารอ้างอิง

1. Likharev, K. K. 1999. Single-Electron Devices and Their Applications. *Proceedings of the IEEE* 87(4): 606-632.
2. Goldhaber-Gordon, D., Shtrikman, H., Mahalu, D., Abusch-Magder, D., Meirav, U., and Kastner, M. A. 1998. Kondo Effect in a Single-Electron Transistor. *Nature* 391(6663), 156-159.
3. Yoo, M. J., Fulton, T. A., Hess, H. F., Willett, R. L., Dunkleberger, L. N., Chichester, R. J., Pfeiffer, L. N., and West, K. W. 1998. Scanning Single-Electron Transistor Microscopy: Imaging Individual Charges. *Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures* 3(1), 8-14.
4. Hess, H. F., Fulton, T. A., Yoo, M. J., and Yacoby, A. 1998. Microscopy with a Single Electron Transistor Probe. *Solid State Communications* 107(11), 657-661.
5. Lafarge, P., Pothier, H., Williams, E. R., Esteve, D., Urbina, C., and Devoret, M. H. 1991. Direct Observation of Macroscopic Charge Quantization. *Zeitschrift für Physik B Condensed Matter* 85(3), 327-332.
6. Degawa, K., Higuchi, T., Inokawa, H., and Takahashi, Y. 2004. A Single-Electron-Transistor Logic Gate Family for Binary, Multiple-Valued and Mixed-Mode Logic. *IEICE Transactions on Electronics* 87(11), 1827-1836.
7. Inokawa, H., Fujiwara, A., and Takahashi, Y. 2003. A Multiple-Valued Logic and Memory with Combined Single-Electron and Metal-Oxide-Semiconductor Transistors. *IEEE Transactions on Electron Devices* 50(2), 462-470.
8. Vrijen, R., Yablonovitch, E., Wang, K., Jiang, H. W., Balandin, A., Roychowdhury, V., Mol, T., and DiVincenzo, D. 2000. Electron-Spin-Resonance Transistors for Quantum Computing in Silicon-Germanium Heterostructures. *Physical Review A* 62(1), 012306.
9. Takahashi, Y., Nagase, M., Namatsu, H., Kurihara, K., Iwdate, K., Nakajima, Y., Horiguchi, S., Murase, K., and Tabe, M. 1995. Fabrication Technique for Si Single-Electron Transistor Operating at Room Temperature. *Electronics Letters* 31(2), 136-137.

10. Averin, D. V., and Likharev, K. K. 1986. Coulomb Blockade of Single-electron Tunneling, and Coherent Oscillations in Small Tunnel Junctions. *Journal of Low Temperature Physics* 62(3-4), 345-373.
11. Devoret, M. H., Esteve, D., and Urbina, C. 1992. Single-Electron Transfer in Metallic Nanostructures. *Nature* 360(6404), 547-553.
12. Yano, K., Ishii, T., Sano, T., Mine, T., Murai, F., Hashimoto, T., Kobayashi, T., Kure, T., and Seki, K. 1999. Single-Electron Memory for Giga-to-Tera Bit Storage. *Proceedings of the IEEE* 87(4), 633-651.
13. Agarwal, B. K., and Eisner, M. 1998. Statistical Mechanics. 2nd Edition. New Delhi. New Age International Publishers Ltd. p. 69-70.
14. Kasfner, M. A. 1993. Artificial Atoms. *Physics Today* 46, 24-31.
15. Imry, Y., and Landauer, R. 1999. Conductance Viewed as Transmission. *Reviews of Modern Physics* 71(2), S306-S312.
16. Theis, C. 2004. Conductance of Single Electron Devices from Imaginary-Time Path Integrals. Doctoral Dissertation, Universitätsbibliothek Freiburg. p. 1-13.
17. Feldheim, D. L., and Keating, C. D. 1998. Self-Assembly of Single Electron Transistors and Related Devices. *Chemical Society Reviews* 27(1), 1-12.
18. Li, P. W., Liao, W. M., Kuo, D., Lin, S. W., Chen, P. S., Lu, S. C., and Tsai, M. J. 2004. Fabrication of a Germanium Quantum-Dot Single-Electron Transistor with Large Coulomb-Blockade Oscillations at Room Temperature. *Applied Physics Letters* 85(9), 1532-1534.
19. De-Picciotto, R., Reznikov, M., Heiblum, M., Umansky, V., Bunin, G., and Mahalu, D. 1997. Direct Observation of a Fractional Charge. *Nature* 389(6647), 162-164.
20. Tans, S. J., Verschueren, A. R., and Dekker, C. 1998. Room-Temperature Transistor Based on a Single Carbon Nanotube. *Nature* 393(6680), 49-52.
21. Takahashi, Y., Fujiwara, A., Yamazaki, K., Namatsu, H., Kurihara, K., and Murase, K. 2000. Multigate Single-Electron Transistors and Their Application to an Exclusive-OR gate. *Applied Physics Letters* 76(5), 637-639.
22. Matsui, S. 1997. Nanostructure Fabrication using Electron Beam and Its Application to Nanometer Devices. *Proceedings of the IEEE* 85(4), 629-643.
23. Kosiorek, A., Kandulski, W., Glaczynska, H., and Giersig, M. 2005. Fabrication of Nanoscale Rings, Dots, and Rods by Combining Shadow Nanosphere Lithography and Annealed Polystyrene Nanosphere Masks. *Small* 1(4), 439-444.

